

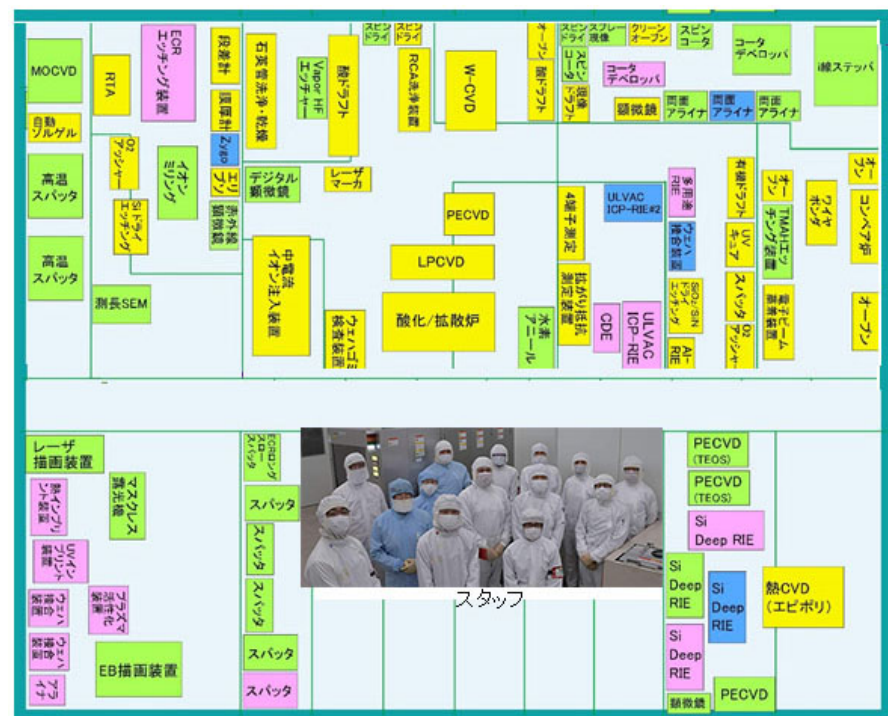
1 試作コインランドリ（戸津健太郎 他）

共用設備で、ユーザが必要な装置に必要な時に利用可能(利用分課金)。技術は保有しているが、試作開発設備がなくて困っている企業などが、人を派遣して自分で試作を行うことで、開発のコスト、リスクを軽減でき、実際の経験を持つ技術者が育つ。これまで大学で蓄積されたノウハウにもアクセス可能。経験を有する技術者が設備維持と使い方の支援。製品製作も行える。

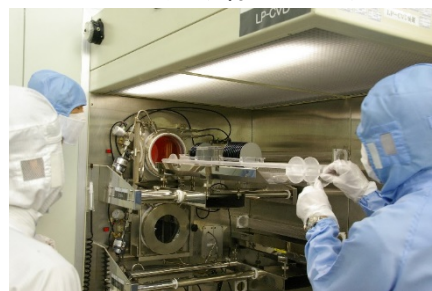
以前パワーTrの製造、組立に使われていた4インチラインにMEMS設備を導入し、4/6インチの試作コインランドリとして使用。<http://www.mu-sic.tohoku.ac.jp/coin/index.html>

問い合わせ先： マイクロシステム融合研究開発センター(西澤記念研究センター内) 戸津健太郎

Tel. 022-229-4113, totsu@mems.mech.tohoku.ac.jp



パターニング (i 線ステッパ)



酸化・拡散



ドライエッチング (DRIE)

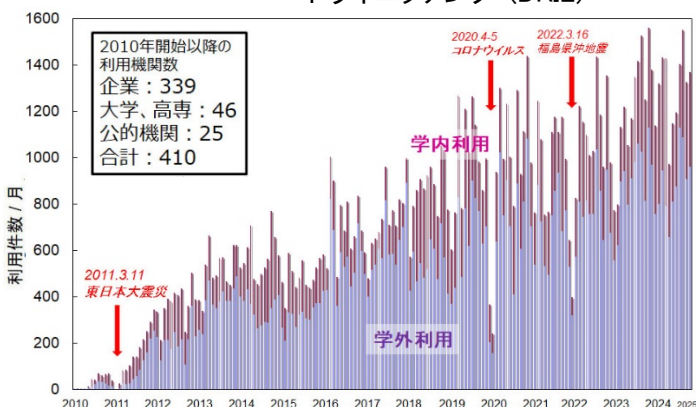
- 2008年にトーキンから引継いだ装置
- 2010年以降に国費(23億円)で新規導入した装置
- 企業や国研等から寄付などで受け入れた装置
- 学内から移設した装置

2F CR 1,800 m² クラス1~1,000

- 熱電子SEM、XRD
- マイクロフォーカスX線CT
- 断面FE-SEM
- EB描画装置
- FTIR、FIB
- AFM



収支の推移



利用件数の推移